# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2004-149915

(43)Date of publication of application: 27.05.2004

(51)Int.CI.

C23C 4/18 4/08 C23C

C23C 4/10 F01D

F02C

(21)Application number: 2003-315995

(71)Applicant: KANSAI ELECTRIC POWER CO INC:THE

MITSUBISHI HEAVY IND LTD

ADVANCED MATERIALS PROCESSING INST

KINKI JAPAN

(22)Date of filing:

08.09.2003

(72)Inventor: MORITSUGU MASAHIKO **OTSUKA HIROMASA** 

TAKAHASHI KOJI OHARA MINORU **MEGA MASAHIKO TORIGOE TAIJI OMORI AKIRA** 

SHIRASAWA HIDENORI

SHU NOBU

(30)Priority

Priority number: 2002261678

Priority date: 06.09.2002

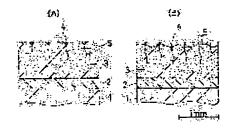
Priority country: JP

## (54) HEAT-SHIELDING CERAMIC COATING PARTS AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a heat-shielding ceramic coating parts which is for use in such equipment as an electricity-generating gas turbine utilized in the region of elevated temperatures and which has an extremely excellent thermal-shock resistance and is manufactured

SOLUTION: The heat-shielding ceramic coating parts comprises a metal substrate 1, an undercoat flame spray coating film 2 which is formed of an alloy of MCrAIY (M is Co or Ni) on the surface of the substrate 1 and a heat-shielding ceramic flame spray coating film 3 which is formed of ZrO2 as a main body on the film 2. The heat-shielding ceramic coating film 3 has a large number of vertical cracks 5 towards the thickness direction from the surface and the average depth of the vertical cracks 5 is made to be in the range of 30-80 % of the thickness of the heatshielding ceramic flame spray coating film.



**LEGAL STATUS** 

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

#### (19) 日本国特許庁(JP)

## (12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開2004-149915 (P2004-149915A)

(43) 公開日 平成16年5月27日(2004.5.27)

(51) Int. C1. 7	۴ı		テーマコード(参考)					
C23C 4/18	C23C	4/18	3G002					
C23C 4/08	C23C	4/08	4KO31					
C23C 4/10	C23C	4/10						
FO1D 5/28	FO1D	5/28						
F02C 7/00	FO2C	7/00	D					
		宋 司 金 審 立 語 求	未請求 請求項の数 9 OL (全 15 頁)					
(21) 出願番号	特願2003-315995 (P2003-315995)	(71) 出願人	000156938					
(22) 出願日	平成15年9月8日 (2003.9.8)		関西電力株式会社					
(31) 優先權主張番号	特願2002-261678 (P2002-261678) 大阪府大阪市北区中之島3丁目37							
(32) 優先日	平成14年9月6日 (2002.9.6)	(71) 出願人 000006208						
(33) 優先權主張国	日本国 (JP)		三菱重工業株式会社					
			東京都港区港南二丁目16番5号					
		(71) 出願人	596132721					
			財団法人近畿高エネルギー加工技術研究所					
		(7.1) (1) 199 1	兵庫県尼崎市道意町7丁目1番8					
		(74) 代理人	100069578					
		(72) 発明者	弁理士 藤川 忠司 森継 正彦					
		(14) 光明音	大阪府大阪市北区中之島三丁目6番32号					
			<b>陝西電力株式会社内</b>					
			最終頁に続く					

#### (54) 【発明の名称】熱遮蔽セラミックコーティング部品とその製造方法

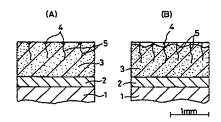
## (57)【要約】

【課題】 発電用ガスターピン等の高温域で使用される機器に用いる熱遮蔽セラミックコーティング部品として、極めて優れた耐熱衝撃性を構え、製造容易なものを提供する。

【解決手段】 金属基材1の表面にMCFAIY(MはCO又はNi)合金からなる下地溶射皮膜2を介して区 FOz を主体とする熱遮蔽セラミック溶射皮膜8が形成され、熱遮蔽セラミック溶射皮膜8に表面から厚み方向へ向かう多数の凝割れ5 を有し、凝割れ5 の平均深さが熱遮蔽セラミック溶射皮膜厚の80~80%の範囲にある。

【選択図】

図1



#### 【特許請求の範囲】

#### 【請求項1】

金属基材の表面にMC ア A I Y (MはC O 又はN i) 合金からなる下地溶射皮膜を介して区 r O 2 を主体とする熱遮蔽セラミック溶射皮膜が形成され、この熱遮蔽セラミック溶射皮膜に表面から厚み方向へ向かす多数の縦割れを有し、これら縦割れの平均深さが当該溶射皮膜厚の 8 0 ~ 8 0 %の範囲にあることを特徴とする熱遮蔽セラミックコーティング部品。

#### 【請求項2】

前記熱遮蔽セラミック溶射皮膜の縦割れが1~5本/mmの密度で存在する請求項1記載の熱遮蔽セラミックコーティング部品。

#### 【請求項3】

前記熱遮蔽セラミック溶射皮膜の表層部がガラス層を構成する請求項1又は2に記載の 熱遮蔽セラミックコーティング部品。

#### 【請求項4】

前記がラス層の平均厚みが熱遮蔽セラミック溶射皮膜の厚みの2~30%の範囲にある請求項3に記載の熱遮蔽セラミックコーティング部品。

#### 【請求項5】

MCトAIY合金からなる下地溶射皮膜の厚みが10~500μm、熱遮蔽セラミック溶射皮膜の厚みが10~5000μmである請求項1~4のいずれかに記載の熱遮蔽セラミックコーティング部品。

#### 【請求項6】

前記熱遮蔽セラミック溶射皮膜の平均表面粗さRのが7. 5μm以下である請求項1~5のいずれかに記載の熱遮蔽セラミックコーティング部品。

#### 【請求項7】

前記金属基材が発電用がスターピンにおけるがス接触部位である請求項1~6のいずれかに記載の熱速蔽セラミックコーティング部品。

#### 【請求項8】

金属基材の表面に、MC r A l Y (MはCo 又はNi)合金がらなる下地溶射皮膜と、 区r O 2 を主体とする熱遮蔽セラミック溶射皮膜とを、順次プラズマ溶射によって形成したのち、該熱遮蔽セラミック溶射皮膜の表面にレーザピームを、パワー密度40~200W/mm²、エネルギー密度2~5 J/mm²の範囲で、且つパワー密度とエネルギー密度の積が180W/mm²・J/mm²以上となる条件で照射することにより、該熱遮蔽セラミック溶射皮膜に請求項1記載の縦割れを形成することを特徴とする熱遮蔽セラミックコーティング部品の製造方法。

## 【請求項9】

前記レーザピームをトップフラット型で照射するようにしてなる請求項8記載の熱遮蔽 セラミックコーティング部品の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### 【技術分野】

[0001]

本発明は、発電用がスターピン等の高温域で使用される機器に用いる熱遮蔽セラミックコーティング部品と、その製造方法に関する。

## 【背景技術】

## [0002]

ガスターピンの翼や燃焼筒等の高温域で使用される耐熱部品として、Ni基耐熱合金基材の表面に、MC r A l Y (MはC o 又はNi)等の耐高温酸化性・耐高温腐食性に優れる下地溶射皮膜を介して、熱速酸セラミック溶射皮膜を形成したものが汎用されている。一般的に、このセラミック溶射皮膜は、区 r O g に M g O 、C a O 、Y g O g 等を加えて安定化させたものであり、プラズマ溶射によって数百 μ m 程度の厚みに形成されるのが普通である。

20

10

30

00

#### [0008]

しかるに、上記のような熱遮蔽セラミック溶射皮膜を設けた耐熱部品にあいても、熱衝撃(加熱一冷却の熱サイクル)の反復により、該セラミック溶射皮膜と下地溶射皮膜との間に界面剥離が発生し易く、苛酷な使用条件では充分な高温耐久性が得られないという問題があった。特にガスターピンの場合、発電効率の向上のために稼働温度をより高くする傾向にあり、これに伴って各部品の高温耐久性を改善して長寿命化を図ることが強く要望されている。なお、基材への熱影響を緩和するためにセラミック溶射皮膜の厚みを増加させた場合は、熱衝撃による内部応力が増大するため、上記の界面剥離はより発生し易くなる。

[0004]

せこで、上記要望に対処する手段として、近年、熱遮蔽セラミック溶射皮膜に厚み方向の割れ(縦割れ)による柱状組織を形成することが提案されている。これは、前記の界面剥離を生じる主因がセラミック溶射皮膜と下地溶射皮膜及び耐熱合金基材との線膨張率の建い(線膨張率:安定化区ケ〇2 溶射層 10~11×10 <sup>8</sup>/K、Ni基耐熱合金及びMCケムーY合金 16×10 <sup>8</sup>/K)にあることがら、予めセラミック溶射皮膜側に割れを形成しておき、この割れによって熱サイクルに伴う膨張・収縮の差を吸収させるというものである。

[0005]

しかして、従来の提案に係る熱遮蔽セラミック溶射皮膜の前記柱状組織の形成方法としては、電子ピームによる蒸着と酸素イオン照射によって安定化区トロ2層を成膜する方法(特許文献1)、プラズマ溶射にて成膜した安定化区トロ2層の表面に後処理としてパルスレーザを局部的に照射する方法(特許文献2)、プラズマ溶射にて安定化区トロ2層を形成する際の溶射条件の制御によって溶射単層(1パス)毎に割れを生じさせてゆく方法(特許文献3)等がある。

【特許文献1】特開平9-67632号公報

【特許文献2】特開平9-327779号公報

【特許文献 8】特許第2710075号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0006]

[0007]

本発明は、上述の事構に鑑みて、発電用ガスターピン等の高温域で使用される機器に用いる熱速酸セラミックコーティング部品として、極めて優れた耐熱衝撃性を備え、且つ製造容易なものを提供することを目的としている。

[0008]

上記目的を達成するために、諸求項1の発明に係る熱遮蔽セラミックコーティング部品は、金属基材の表面にMC ケムーY(MはCo 又はNi)合金からなる下地溶射皮膜を介して区ケO2を主体とする熱遮蔽セラミック溶射皮膜が形成され、この熱遮蔽セラミック

10

20

30

40

..

溶射皮膜に表面から厚み方向へ向かう多数の縦割れを有し、これら縦割れの平均深さが当該溶射皮膜厚の 8 0 ~ 8 0 %の範囲にあることを特徴とするものである。

#### [0009]

また、この請求項1の発明に係る熱遮蔽セラミックコーティング部品の好適態様として、請求項2の発明では前記熱遮蔽セラミック溶射皮膜の縦割れが1~5本/MMの密度で存在する構成、請求項3の発明では前記熱遮蔽セラミック溶射皮膜の表層部がガラス層をなす構成、請求項4の発明では前記がラス層の平均厚さが熱遮蔽セラミック溶射皮膜の厚みの2~80%の範囲にある構成、請求項5の発明ではMCケムーY合金からなる下地溶射皮膜の厚みが10~500μm、熱遮蔽セラミック溶射皮膜の厚みが10~5000μmである構成、請求項3の発明では前記金属基材が発電用がスターピンにおけるがス接触部位である構成、をされてれ採用している。

#### [0010]

一方、請求項8の発明に係る熱遮蔽セラミックコーティング部品の製造方法は、金属基材の表面に、MC r A l Y (MはC o 又はN i ) 合金からなる下地溶射皮膜と、 区 r O 2 を主体とする熱遮蔽セラミック溶射皮膜とを、 順次プラズマ溶射によって形成したのち、 該熱遮蔽セラミック溶射皮膜の表面にレーザピームを、 パワー密度40~200W/mm²、 エネルギー密度2~5J/mm²の範囲で、 且つパワー密度とエネルギー密度の積が180W/mm²・J/mm²以上となる条件で照射することにより、 該熱遮蔽セラミック溶射皮膜に請求項1記載の縦割れを形成することを特徴としている。 また、 請求項9の発射皮膜に請求項6の遮蔽セラミックコーティング部品の製造方法において、 前記レーザピームをトップフラット型で照射する構成としている。

## 【発明の効果】

#### [0011]

請求項1の発明によれば、発電用がスターピン等の高温域で使用される機器に用いる熱 遮蔽セラミックコーティング部品として、 表面にMC ケ A I Y (MはC O 又は Ni)合会 からなる下地溶射皮膜を介して区 ケ O 2 を主体とする熱 遮蔽セラミック溶射皮膜が形成 れ、この熱 遮蔽セラミック溶射皮膜に、 表面 から厚み 方向へ特定深さに達する多数の 和 も 方 することから、 使用中の熱衝撃による 熱 遮蔽 セラミック溶射皮膜の 界面 剥離を生じに くいものが提供される。 また、このコーティング 部 品は、 表層部が 密化することに 引い、 腐食性高温雰囲気の影響が下地に及びにくくなり、 高温耐久性、 耐高温腐食性、 耐温酸 化性等の熱的性能、 耐エロージョン特性等に優れて長寿命である上、 製造容易で低コスト化を実現できる。

#### [0012]

請求項2の発明によれば、上記の熱遮蔽セラミックコーティング部品において、熱遮蔽セラミック溶射皮膜の概割れが特定密度で存在することから、耐熱衝撃性がより向上するという利点がある。

#### [0018]

請求項3の発明によれば、上記の熱速蔵セラミックコーティング部品において、熱遮蔽セラミック溶射皮膜の表層部がガラス層を構成することから、その製造において該縦割れを確実に形成できるという利点がある。

#### [0014]

請求項4の発明によれば、上記の熱遮蔽セラミックコーティング部品において、ガラス層の平均厚みが特定範囲にあることがら、その製造において該殺割れを確実に形成できることに加え、熱遮蔽セラミック溶射皮膜による熱遮蔽作用を充分に確保できるという利点がある。

## [0015]

3

請求項5の発明によれば、上記の熱速蔵セラミックコーティング部品において、下地溶射皮膜及び熱速蔵セラミック溶射皮膜が特定の厚み範囲にあることがら、少ない材料コストで充分な耐熱衝撃性を備えるものが提供される。

20

ያስ

--

#### [0016]

請求項6の発明によれば、上記の熱遮蔽セラミックコーティング部品において、熱遮蔽セラミック溶射皮膜の表面粗さが特定値以下であることがら、発電用がスターピンにおけるがス接触部位のように、その表面に高速で飛翔する固形粒子が衝突する使用条件下での皮膜表面の耐摩耗性に優れており、このような使用条件で用いる部品としての耐久性がより向上するという利点がある。

#### [0017]

請求項7の発明によれば、上記の熱遮蔽セラミックコーティング部品において、前記金属基材が発電用がスターピンにおけるがス接触部位であることがら、用途的に前記各請求項の発明による作用効果が最も活かされるものとなる。

#### [0018]

請求項8の発明に係る製造方法によれば、金属基材の表面に前記下地溶射皮膜と熱遮蔽セラミック溶射皮膜とを順次プラズマ溶射によって形成したのち、該熱遮蔽セラミック溶射皮膜の表面にレーザピームを特定のパワー密度及びエネルギー密度で照射する後処理を施すことから、前記の熱的性能に優れて長寿命な熱遮蔽セラミックコーティング部品を容易に且つ確実に製造できる。

#### [0019]

請求項9の発明によれば、上記の熱遮蔽セラミックコーティング部品の製造方法において、後処理のレーザピームをトップフラット型で照射することから、皮膜性状を均質化できると共に処理能率が向上することに加え、被処理表面が曲面状であって安定した処理条件を確保できるという利点がある。

【発明を実施するための最良の形態】

#### [0020]

図1は本発明に係る熱遮蔽セラミックコーティング部品の表層部の断面組織を模式的に示しており、(A)は後述する熱衝撃試験での皮膜面積50%剥離までのサイクル数9の評価が得られた断面組織、(B)は同サイクル数18の評価が得られた断面組織である。

## [0021]

図1 (A) (B) にあいて、1は金属基材、2は該金属基材1上に設けられたMC PA | Y (MはCo又はNi) 合金からなる下地溶射皮膜、3は該下地溶射皮膜2上に設けられた区 PO2 を主体とする熱遮蔽セラミック溶射皮膜であり、この熱遮蔽セラミック溶射 皮膜3の表層部には溶触で 密化したガラス層4を有すると共に、該セラミック溶射皮膜 3の表面から厚み方向へ向かす多数の縦割れ5 が形成されている。しかして、これら縦 割れ5 は、下地溶射皮膜2との界面まで達しない深さになっている。

#### [0022]

このような熱遮蔽セラミックコーティング部品では、熱遮蔽セラミック溶射皮膜3が縦割れ5 による柱状組織を有するため、発電用がスターピン等の部品としての線形でで、発電用がスターピン等の部品としての線形でで、発電用がスターピン等の部品としての線形でで、発動力皮膜3と下地溶射皮膜2度はしていないたので、下地溶射皮膜2とセラミック溶射皮膜3との密着性がよいから、両溶射皮膜2、3間の界面剥削がよりににく、該セラミック溶射皮膜3の表面側からの緩割れ5 は深さ方向溶射皮膜2が緩割れ5 はない、下地溶射皮膜2が緩割れ5 はない、下地溶射皮膜2が緩割れ5 はない、下地溶射皮膜2が緩割れ5 を通して直接に腐食性高温雰囲気の影響を受けることはなく、もって可監な使用条件でも極めて優れた高温耐久性が得られる。

#### [0028]

しかして、本発明の熱遮蔽セラミックコーティング部品では、熱遮蔽セラミック溶射皮膜3に形成する殺割れ5 の全てを一定の深さに描えることは技術的に困難であることがら、これら殺割れ5 の平均深さが当該溶射皮膜厚の30~80%の深さ範囲にあるものとし、且つ殺割れ5 の密度を1~5本/mmとする。すなわち、前記殺割れ5 の平均

10

20

30

40

深さが該溶射皮膜厚の30%を下回る場合は、これら縦割れ5 による内部応力の吸収緩和が不充分になり、逆に該平均深さが該溶射皮膜厚の80%を上回る場合は、下地溶射皮膜2が縦割れ5 を通して直接に腐食性高温雰囲気の影響を受け易くなり、共に高温耐久性が惡化することになる。一方、縦割れ5 の密度については、1本/mm未満では内部応力の吸収緩和が不充分になり、また5本/mmを越えるものは、内部応力の緩和効果はあるが、実使用環境での熱衝撃に伴う皮膜炎面の部分剥離が生じ易くなる。

本発明の熱遮蔽セラミックコーティング部品におけるMCFAIY合金からなる下地溶射皮膜2の厚みは、設部品の種類によって最適値が異なるが、一般的になりとなり、厚地ででは耐高温酸と性が不充分となり、厚地でではり設部品の種類によって最適値が異なるが、一般的には10~5000μmののでは、対好適であり、薄過ぎては耐熱衝撃性が不充分となり、厚過ぎても熱衝撃によって最適値が不充分となり、厚過ぎても熱衝撃によって最適値が不充分となり、厚過ぎても熱衝撃によって最適値が不充分となり、厚過ぎても熱衝撃によって最適になる。なお、溶射粒子の経は概して50μm前後であり、一回の溶射(1尺ス)で就速蔵セラミック溶射皮膜30μm内外であるため、それ以上の厚みの下地溶射皮膜2及び熱遮蔽セラミック溶射皮膜3は所要の厚さになるまで溶射を重ねることになる。

[0025]

[0024]

ってった、熱遮蔽 セラミック溶射皮膜 3 のセラミック材料 2 しては、 M 3 の、 C 4 の 4 で 4 を 加えて 安定 化 させた 4 としては、 インコネル等の N 4 を 耐熱 合金 が 好適である。

[0026]

該セラミック溶射皮膜3の表層部のガラス層4に関しては、後述する縦割れ5 を形成するためのレーが後処理において、ガラス層4の形成が縦割れ5 の生成及び皮膜の表面性状に大きく関与することが判明している。このようなガラス層4は、レーが後処理におけるパワー密度及びエネルギー密度の増加に伴って厚みを増す一般的傾向が認められるが、その平均厚さが熱遮蔽セラミック溶射皮膜3の厚みの2~80%の範囲とするのがよい。すなわち、このガラス層4が薄過ぎては、縦割れ5 が生成しにくくなる。また逆にガラス層4が厚過ぎては、レーが後処理において溶射皮膜3の剝離を生じ易くなると共に、皮膜表面が波状を呈することに起因して耐摩耗性を劣化させることになる。

[0027]

上記の耐摩耗性は、発電用がスターピンにおけるがス接触部位のように、その表面に高速で飛翔する固形粒子が衝突する使用条件下での皮膜強度を意味する。すなわち、発電にオスターピンにおけるターピンの動翼や静翼、ケーシングの内周部等のがス接触部でおい、流通間隙を高温高圧のがスか高速で通過するため、がス中に付随している煤や磨の多量の固形微粒子が接触部表面に継続的に衝突・擦過することになり、これによって触部表面が削り取られて摩耗し易い。従って、このようながス接触部に用いる部として機れた耐久性を確保するには、熱遮蔽セラミックコーティングによって耐熱衝撃性を高いることに加え、該コーティング層の耐摩耗性を向上させることが極めて重要となる。

[0028]

[0029]

30

10

20

本発明の熱遮蔽セラミックコーティング部品を製造するには、金属基材 1 の表面に、MCトAIY(MはCO又はNi)合金からなる下地溶射皮膜2と、区 PO2 を主体とする熱遮蔽セラミック溶射皮膜3 で 表面にレーザピームを適度なパワー密度及びエネア溶射によって形成したのち、後処理として該熱遮蔽セラミック溶射皮膜3 の表面にレーザピームの照射により、該熱遮蔽セラミック溶射皮膜3 の表層部が加熱されて溶融し、溶融粒子間の結合力によって組織が一密化するが、レーザピームの照射スポットから外れて急速に冷却固化するの固化収縮に伴り、該セラミック溶射皮膜3 に表面から外れて急速に冷却固化するの固化収縮に伴り、該セラミック溶射皮膜3 に表面から厚み方向へ向かう多数の縦割れ5 が表面から見て網目状に形成されることになる。

#### [0080]

#### [0031]

レーザ後処理は、図2で示すように、金属基材1上にMCFAIY合金の下地溶射を皮膜3の大力して設けられた熱速酸セラミック溶射皮膜3の表面に、レーザピーム6を相対移動した。 これは、カライドスコープ等でレーカーがピーム6によれば、一回の走査で広い領域に均等に照射できるため、皮膜性状を均質ができると共に処理能率が向上することに加え、例えばターピン翼のように被処理表面状であって直線的な用対移動ではレーザピーム6の出射位置からの距離が変化する場合でも、照射面でのパワー密度は殆ど変わらなり、もって安定した処理条件を確保できることによる。使用するレーザの種類は特に制約されないが、取扱い性や制御の容易さがら連続発振のYAGレーザが好適である。

#### [0082]

なお、溶射形成後の熱遮蔽セラミック溶射皮膜 8 にはそのまま上記のレーザ後処理を施せるが、溶射皮膜 2、 3 と基材 1 との密着性を向上させる目的で必要とあらば、該セラミック溶射皮膜 3 に真空拡散熱処理を行った上でレーザ後処理を施してもよい。ただし、この真空拡散熱処理を経た場合は皮膜表面が黒色化し、次のレーザ後処理における熱吸収が大きくなることから、該レーザ後処理での皮膜剝離を防止するためにレーザビーム 6 のエネルギー密度を比較的に小さく設定するのがよく、好適には 3 J/mm² 以下とすることが推奨される。

#### [0088]

本発明の熱遮蔽セラミックコーティング部品は、高温域で使用される機器の大きな熱衝撃が加わる部位に用いられるものであり、その用途及び部品種には特に制約はないが、とりわけ発電用がスターピンにあけるがス接触部位、例えばターピンの動翼や静翼、ケーシング内周部等に用いる部品として好過である。

#### 【実施例】

#### [0084]

〔下地溶射皮膜及び熱遮蔽セラミック溶射皮膜の形成〕

10

20

30

縦横 2 5 mm. 厚さ 5 mmのインコネル合金板の複数枚を金属基材として用い、これらのプラスト処理(# 2 4 番アルミナ粉)した表面にされざれ、減圧プラズマ溶射によってCoNiCrAlY合金がらなる下地溶射皮膜を形成し、この下地溶射皮膜上に大気中プラズマ溶射によってZrO₂ -Y₂O₃ からなる熱遮蔽セラミック溶射皮膜3を形成し、試験片を作製した。使用した溶射粉末とプラズマ溶射条件を次の表1~表3に示す。

## 【0085】 【数1】

[CoNiCrAlY溶射粉末…昭和電工社製、粒度10~45μm]

	1	化 学	組 成	(mass	; %)	
Со	N i	C r	A 1	Y	Fe	С
残余	32. 1	21.0	8. 4	0.61	0.04	0. 02

## 【0086】 【表2】

[ZrO<sub>2</sub>-Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 溶射粉末…昭和電工社製、粒度10~45μm]

	化 学	組 成	(mass%)	
ZrOz	Y 2 O 3	A 1 2 O 3	S-i 0 2	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
91.62	7.88	0. 02	0.07	0.08

## 【0087】 【表3】

## [プラズマ溶射条件]

·	下地溶射皮膜	セラミック溶射皮膜
電流: A	6 0 0	6 0 0
電圧: V	4 5	4 7
メインガス(Ar):1/min	25.0	2 5. 0
アシストガス :1/min	Н 2 … 3. 0	N <sub>2</sub> ··· 4. 0
溶射雰囲気	A r … 1 0 0 Torr	大 気
溶射距離:mm	1 5 0	1 0 0
粉末供給ガス:1/min	3. 0	5. 0
粉末供給量: r p m	1. 0	2. 0
皮 膜 厚: μm	約100	約300

## [0088]

〔レーザ後加工〕

前記の下地溶射皮膜及び熱遮蔽セラミック溶射皮膜を形成した各試験片について、その 50

20

10

30

[0039]

なお、レーザピームは照射面でのピームスポットが 5 mmロのトップフラット型で照射 ピッチ(レーザ走査ラインの間隔)4 mmとし、エネルギー密度は 8 段階のレーザ出力( 8.5 KW、2.0 KW、1.0 KW)と照射速度(10~700 mm/Sec)とから 設定した。また、耐熱衝撃性は、試験片を電気炉内に装填し、炉温度が 1303° Kに到 達後 2 分間保持して取り出し、直ちに氷水中に浸漬するのを 1 サイクルとし、皮膜面積の 50%が剥離するまでのサイクル数を調べた。

[0040]

耐摩耗性については、縦50mm、横60mm、厚さ5mmのインコネル合金板を基材として、前述と同様の方法によってプラスト処理、下地溶射、熱遮蔽セラミック溶射を施して作製した試験片に、#24アルミナ粉を噴射速度114m/秒で30分吹き付け、これによる試験片の重量減少を調べた。

[0041]

								_	-							T			$\overline{}$	
品熱係數件	(#47N)	3	7	1 8	1 9	1.7	1 6	3.	5	8	6	1.4	1	. 1	4	6	l		3	
摩耗量 m g		0 9	44	3 2	26	6 0	153	5 7	5 5	4.5	4 .0	8 3	1		6 1	3 9	1	۱	6 2	
熱遮蔽セラミック溶射皮膜 (厚さ約300μm)	表面粗さ Ra	4.3	4.5	4.0	4.9	7.2	8.3	4.5	4.6	4.7	6.0	7.8	測定不能	測定不能	4. 2	4.6	測定不能	測定不能	4.3	
	表面状態	良好	良好	良好	良好	やや不均一	凹凸、一部剝離	良好	良好	良好	やや不均一	やや不均一	四凸、剝離顕著	凹凸、剝離顕著	良好	良好	凹凸、剝離顕著	凹凸、剝離顕著	良好	
	ガラス層 膜厚比%	0	5.5	10.5	1 7	2 3	3 0	0	1.0	3.0	5.5	7. 0	١		0	2.5		1	0	
	統割れ深さ μm	縦割れなし	103	143	196	217	2 5 8	7 8	1 2 3	159	183	198		I	8 8	1 3 7	-	1	縦割れなし	
	森 巻 本 一 昌	凝割れなり	1. 79	3. 12	3. 15	2. 70	1.65	0.56	0.78	2.30	2.68	2. 52			0.61	1. 15	_		統割れなし	
レーザ後処理条件	P×E 密廉權	140	280	420	260	700	086	160	240	320	400	260	800	1040	. 80	200	400	008	理なし	
	E 密度 J/晶 <sup>2</sup>	-	2	3	4	5	7	2	က	4	2	7	10	13	2	2	10	82	一节後処	
	P 密展 W/晶 <sup>2</sup>	140	140	140	140	140	140	8	80	80	80	80	80	80	40	40	40	40	ذ	
71 03 4	Z Z Z	-	2	3	4	5	9	7	∞	9	10	11	12	13	14	15	16	17	参考例	

## [0042]

表4より、熱遮蔽セラミック溶射皮膜に設けた概割れの密度(平均)が1~5本/mmで、且っ種割れの深さ(平均)が該セラミック溶射皮膜の80~80%の範囲内である試験片(NO.2~5.9~11.15)では7サイクル以上の高い耐熱衝撃性を示し、特

10

20

30

40

にレーザ後処理におけるパワー密度を140W/mm²、エネルギー密度を3~5J/mm²とした試験片(No.3~5)では17サイクル以上という極めて優れた耐熱衝撃性が得られている。しかし、皮膜の表面粗さ(Ra)が7.5μmより大きい試験片No.11では、参考例のレーザ後処理を施していない試験片に比べて耐摩耗性が劣っている。これは、皮膜の表面状態に関係しており、皮膜表面が波状に凹凸化して粗くなると、その凸部に摩耗粉の衝突が集中して局所的な皮膜の損傷を生じると共に、この損傷部分から連鎖的に摩耗が拡大するものと考えられる。

#### [0048]

一方、縦割れの密度が1本/mm未満であったり、同深さがセラミック溶射皮膜の30%未満である試験片(No. 1、14)では、充分な耐熱衝撃性が得られていない。また、レーザ後処理で5J/mm² を越えるエネルギー密度に設定した試験片(No. 6、11~13、16、17)では、レーザ後処理による溶射皮膜の表面荒れや剥離を生じている。更に、パワー密度とエネルギー密度との積を180W/mm²・W/mm² 以上に設定すれば、縦割れの密度を1本/mm以上、同深さをセラミック溶射皮膜の30%以上になし得ることが判る。

#### [0044]

図3は、上記実施例でレーザ後処理を施した試験片における耐熱衝撃性試験の測定値と、そのレーザ後処理のパワー密度及びエネルギー密度とから導かれる耐熱を性相関特にできる。この図より、パワー密度が一定である場合、概してエネルギー密度が大くとか高域ではエネーを度が小される。しかして、セラミをが小さくを強力を強力をできる。とかがあることを対して、セラミを対して、セラミを対して、セラミを対して、セラミを対して、セラミを対して、セラミを対して、セラミを対して、セラミを対して、ローンを関があることが望ました。との積が180W/mm²で、且つパワー密度とエネルギー密度との積が180W/mm²で、リー密度とエネルギー密度を対象衝撃性を付与することが望ましいと言える。

#### [0045]

図4は上記実施例でレーザ後処理を施した試験片について、レーザ後処理のパワー密度及びエネルギー密度と熱遮蔽セラミック溶射皮膜の縦割れ密度との関係を示しており、4中に付記した破線は前記耐熱衝撃性のタサイクル線(図3参照)である。この図より、セラミック溶射皮膜に形成される縦割れはパワー密度が大きいほど増えるが、パワー密度の大きい領域ではエネルギー密度が比較的に低い範囲に縦割れ密度のピークがあり、図4中の耐熱衝撃性タサイクル線と縦割れ密度2、2mm 1線あるいは2.6mm 2をの近側から示唆されるように、エネルギー密度2~5 J/mm²の範囲では縦割れ密度が大きいほど耐熱衝撃性は向上する傾向を示している。

#### [0046]

図5は上記実施例でレーザ後処理を施した試験片について、レーザ後処理のパワー密度及びエネルギー密度と熱遮蔽セラミック溶射皮膜の縦割れ深さとの関係を示しており、セラミック溶射皮膜に形成される縦割れの深さは、パワー密度よりもエネルギー密度に大きく影響され、エネルギー密度の増大に伴って顕著に増加するが、耐熱衝撃性タサイクル線との対比で示唆されるように耐熱衝撃性とある程度の相関があり、エネルギー密度2~5 J/mm²の範囲では深くなるほど耐熱衝撃性は向上する傾向を示している。

#### [0047]

図6は上記実施例でレーザ後処理を施した試験片について、熱遮蔽セラミック溶射皮膜におけるガラス層の厚さと耀割れの深さとの関係を示したものである。この図がら明らがなように、ガラス層の厚さは形成される縦割れの深さにある程度対応しており、ガラス層の厚さが増すと縦割れの深さも大きくなる傾向を示している。

#### [0048]

50

図7は、表4に示す各試験片(NO.1~17及び参考例)の皮膜の表面粗さ(Ra)と耐摩耗性との関係を表している。この図から明らかなように、表面粗さ(Ra)7.5 ムmを境として、それより表面状態が粗くなるにしたがって摩耗量は激増している。これは、レーが後処理による皮膜表面のガラス化が進み過ぎると、皮膜表面が凹凸状になって荒れ、摩耗粉の衝突による皮膜の脱落を生じ易くなることを示唆している。これに対し、表面粗さ(Ra)が7.5 ムm以下の皮膜は、表面粗さと耐摩耗性との相関は顕著ではる、かが、総じてレーが後処理を施していない参考例の皮膜よりも摩耗量が少なくなってりないが、総じてレーが後処理を施していないを考例の皮膜よりも摩耗量が少なくなっている。これは、皮膜表面が適度にガラス化されると、表面が滑らかになって摩耗粉の衝突による皮膜分離が生じにくくなるものと考えられる。

[0049]

図8は、上記実施例でレーザ後処理を施した試験片NO. 3の溶射皮膜部の断面組織を示す電子顕微鏡写真である。この電子顕微鏡写真において、最下部のやや色の薄い部分が基材、その上の色が濃い部分がCONiCFAIY合金の下地溶射皮膜、更にその上の大部分を占めているのが区FO₂ - Y₂ O₃ の熱遮蔽セラミック溶射皮膜である。しかして、該セラミック溶射皮膜の表面から厚さ方向に縦割れが形成されているが、この縦割れは下地溶射皮膜との界面までは達しておらず、また該セラミック溶射皮膜の表層部が 密化したガラス層をなしていることが判る。

【図面の簡単な説明】

[0050,]

【図1】本発明に係る熱遮蔽セラミックコーティング部品の表層部の断面組織を示し、(A)は熱衝撃性9サイクルの評価が得られた同部品の模式断面図、(B)は同18サイクルの評価が得られた同部品の模式断面図である。

【図2】同熱遮蔽セラミックコーティング部品の製造におけるレーザ後処理を示す要部の 模式断面図である。

【図3】本発明の実施例でレーザ後処理を施した試験片における耐熱衝撃性とレーザ後処理のパワー密度及びエネルギー密度との関係を示す相関特性図である。

【図4】同実施例でレーザ後処理を施した試験片におけるレーザ後処理のパワー密度及びエネルギー密度と熱遮蔽セラミック溶射皮膜の縦割れ密度との関係を示す相関特性図である。

【図 5 】同試験片におけるレーサ後処理のパワー密度及びエネルギー密度と熱遮蔽セラミ y ク溶射皮膜の織割れ深さとの関係を示す相関特性図である。

【図 6 】同実施例でレーサ後処理を施した試験片における熱遮蔽セラミック溶射皮膜のガラス層の厚さと縦割れ深さとの関係を示す相関特性図である。

【図7】同試験片とレーザ後処理を施さなかった参考例の試験片の耐摩耗性試験による表面粗さと摩耗量との関係を示す相関特性図である。

【図8】同実施例でレーザ後処理を施した小サイズの一試験片の溶射皮膜部の断面組織を示す電子顕微鏡写真図である。

【符号の説明】

[0051]

- 1 金属基材
- 2 下地溶射皮膜
- 8 熱遮蔽セラミック溶射皮膜
- 4 ガラス層
- 5 凝割れ
- 6 レーザピーム

20

10

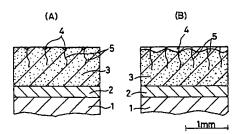
30

40

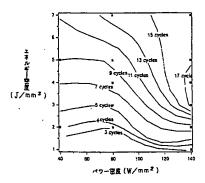
ġ

. : :

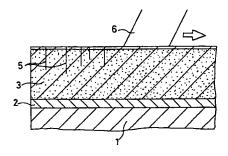
[21]



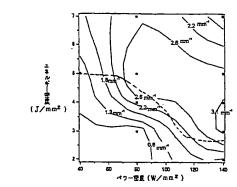
[23]



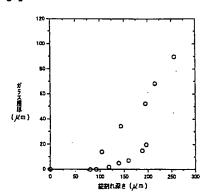
[22]



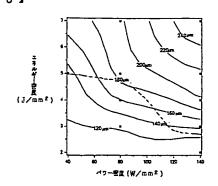
【図4】



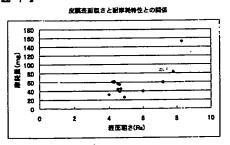
[ 22 6 ]

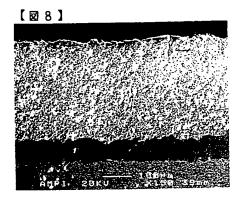


[25]



【図7】





Par Aranoble Copy

#### フロントページの続き

(72)発明者 大塚 弘雅

大阪府大阪市北区中之岛三丁目3番22号 関西電力株式会社内

(72)発明者 高橋 孝二

兵庫県高砂市荒井町新浜2丁目1番1号 三菱重工業株式会社高砂製作所内

(72) 発明者 大原 稔

兵庫県高砂市荒井町新浜2丁目1番1号 三菱重工業株式会社高砂製作所内

(72)発明者 要鹿 雅彦

兵庫県高砂市荒井町新浜2丁目1番1号 三菱重工業株式会社高砂研究所内

(72)発明者 為越 泰治

兵庫県高砂市荒井町新浜2丁目1番1号 三菱重工業株式会社高砂研究所内

(72)発明者 大森 明

兵庫県尼崎市道意町七丁目1番8号 財団法人近畿高エネルギー加工技術研究所内

(72)発明者 白沢 秀則

兵庫県尼崎市道意町七丁目1番8号 財団法人近畿高エネルギー加工技術研究所内

(72)発明者 周 展

・ 兵庫県尼崎市道意町七丁目1番8号 財団法人近畿高エネルギー加工技術研究所内

Fターム(参考) 3G002 EA04 EA05 EA06 EA08

4K081 AA02 AA08 AB08 AB08 CB21 CB22 CB26 CB27 CB42 DA04 EA07 EA10 FA01 FA18